

УДК 537.311.322

**ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПЛЕНОК ПОЛИИМИДА ПМ,
ПОДВЕРГНУТЫХ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКЕ**

*A. H. Алешин, A. B. Грибанов, A. B. Добродумов,
A. B. Суяров, И. С. Шлимак*

Исследованы структура и электрофизические свойства пленок термостойкого полимера — полиимида ПМ, подвергнутого бомбардировке ионами Ar^+ и N^+ . Проводимость $\sigma_{300\text{K}}$ облученного слоя более чем на 15 порядков превышала $\sigma_{300\text{K}}$ необлученных пленок. Анализ зависимостей $\sigma(T)$, $\sigma(E, T)$, $\sigma(\omega, T)$ показал, что проводимость облученных пленок описывается прыжковым механизмом. Обнаружено, что переход от переменной к постоянной энергии активации, наблюдаемый с понижением температуры при $T \leq 4.0$ К в температурной зависимости проводимости, аномальная температурная зависимость магнитосопротивления и сигнала ЭПР в облученном полимида ПМ обусловлены эффектом магнитного упорядочения в системе локализованных спинов.

Электропроводящие полимеры привлекают к себе все большее внимание как материалы, перспективные для использования в различных областях электроники [1]. В большинстве известных работ высокие значения электропроводности полимеров достигаются путем химического легирования [2] или термической деструкцией посредством пиролиза в вакууме и в инертной среде [3]. В последнее время в ряде работ удалось, используя метод ионной бомбардировки, получить тонкие высокопроводящие слои полимеров [4–7].

Целью настоящей работы явилось исследование электрофизических свойств проводящего слоя, образующегося на поверхности пленки полимида ПМ при его ионной бомбардировке. Энергия ионов Ar^+ и N^+ изменялась в пределах 40—90 кэВ, дозы от $3 \cdot 10^{15}$ до $3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2}$, облучение проводилось на ускорителе ИЛУ-4. Разогрев образцов в процессе облучения на охлаждаемой водой подложке не превышал 100 °C, без охлаждения — 350 °C. Глубина модифицированного ионами слоя полимера оценивалась на основе данных по ионной имплантации полупроводников и для энергии ионов 90 кэВ составила порядка 1000 Å [8]. Контакты к облученному слою формировались в планарной геометрии напылением золотых площадок, к которым серебряной пастой крепились измерительные провода.

1. Экспериментальные результаты

Были исследованы химический состав и структура облученного поверхностного слоя, характер температурной зависимости проводимости $\sigma(T)$ (при $T=300 \pm 0.9$ К), температурные (при $T=4.2 \pm 0.47$ К) и полевые (до 60 кЭ) зависимости магнитосопротивления, влияние электрических (до 600 В/см) полей на $\sigma(T)$. Измерена частотная (до $\omega=3 \cdot 10^7$ Гц) зависимость проводимости, дозовые и температурные (при $T=30 \pm 4.0$ К) зависимости сигнала ЭПР.

Исследование химического состава и структуры поверхностного слоя облученной пленки проводилось методом рентгеновской фотоэлектронной

спектроскопии (РФЭС) на приборе ЭСХАЛАБ-5 фирмы «Вакуум—Дженерейтес». На рис. 1 показана зависимость элементного состава приповерхностного слоя полиимида ПМ от дозы облучения. Основное отличие облученных пленок от пиролизованных в вакууме заключается в значительном обеднении модифицированного ионами слоя азотом. По аналогии с работой [9], где при облучении полиимида УФ лазером наблюдался значительный рост количества HCN в газообразных продуктах деструкции, можно предположить, что аналогичные реакции протекают и при ионной бомбардировке полимера. Изменение РФЭ спектров свидетельствует о том, что при облучении ионами, как и при пиролизе [10], происходит ароматизация и последующая карбонизация исходного полимера.

На рис. 2 приведены дозовые зависимости удельного сопротивления при комнатной температуре $\rho_{300\text{ K}} = [\sigma_{300\text{ K}}]^{-1}$ пленок ПМ, облученных ионами Ar^+ и N^+ с $W=90$ кэВ, и зависимость $\sigma_{300\text{ K}}$ (D) из работы [4] (штриховая линия) для облученных ионами Ar^+ с энергией 1 МэВ пленок Каптона. Видно, что в обоих случаях зависимость $\sigma_{300\text{ K}}$ от дозы является очень резкой, а величина $\sigma_{300\text{ K}}$ в нашем случае не зависит от вида иона. Различие с данными [4] в величине проводимости, по-видимому, обусловлено разо-

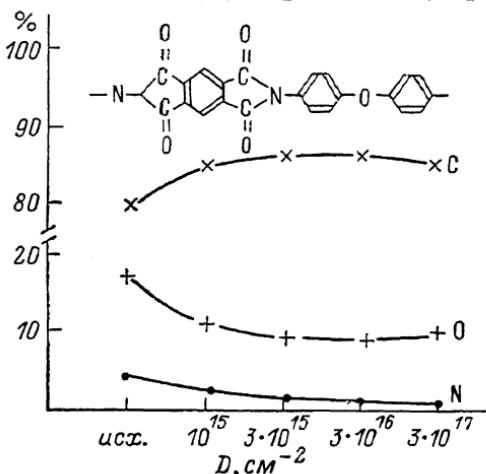


Рис. 1. Химический состав поверхности пленки полиимида ПМ, модифицированной ионами Ar^+ , в зависимости от дозы облучения. Структура исходного полиимида ПМ — $(\text{C}_{22}\text{H}_{10}\text{O}_5\text{N}_2)_n$.

гревом пленки при бомбардировке ионами. Это подтверждается сравнением проводимости $\sigma_{300\text{ K}}$ пленок, полученных на охлаждаемой подложке и без охлаждения, когда пленка нагревалась под действием ионного пучка до температуры $\sim 350^\circ\text{C}$. При этом нами было получено существенное увеличение $\sigma_{300\text{ K}}$ до $200 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ (что более чем на 15 порядков превосходит $\sigma_{300\text{ K}}$ необлученных пленок), а значения $\sigma_{300\text{ K}}$ оказались близкими к данным [4]. Необходимостью разогрева можно объяснить и тот факт, что проводимость пленок растет с ростом энергии ионов и величины ионного тока. Полученные проводящие пленки ПМ сохранили механические свойства и термостабильность до температуры 350°C , а при нагреве выше 350°C разрушались. Уменьшение $\sigma_{300\text{ K}}$ при хранении на воздухе составляло 5–20 % в течение первого месяца, в дальнейшем проводимость практически не изменялась. Измерения термоэдс показали, что облученные слои ПМ имеют проводимость n -типа.

На рис. 3 показаны результаты исследования температурной зависимости удельного сопротивления $\rho(T) = [\sigma(T)]^{-1}$ некоторых пленок, облученных без охлаждения подложки. Видно, что с ростом дозы облучения наблюдается переход от полупроводникового (активационного) характера проводимости (кривые 1–3) к металлической проводимости с очень слабой зависимостью $\sigma(T)$ (кривые 5, 6). Например, для образца 6 температурная зависимость $\sigma(T)$ при $1.6 \text{ K} < T < 10 \text{ K}$ хорошо описывается выражением

$$\sigma(T) = \sigma(0) + AT^{0.5}, \quad (1)$$

где $\sigma(0) = 2 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$, $A = 17.7$. Для образцов на диэлектрической стороне перехода анализ температурной зависимости приведенной энергии актива-

¹ Авторы благодарны А. В. Шукареву и Т. А. Антоновой за помощь в проведении этих исследований.

ции $\sigma(T)/kT$ показал, что по мере понижения температуры можно выделить три области с различным характером зависимости $\sigma(T)$. В интервале температур $300 \div 50$ К наблюдается степенная зависимость $\sigma(T) \sim T^n$, где $n \sim 1$, а при температурах $50 \div 4.0$ К — экспоненциальная зависимость $\sigma(T)$ со скользящей энергией активации

$$\sigma(T) = \sigma_0 \exp [-(T_0/T)^m], \quad (2)$$

где $m \sim 0.5$. При температурах ниже 4.0 К наблюдается переход к экспоненциальной зависимости $\sigma(T)$ с постоянной энергией активации

$$\sigma(T) = \sigma_0 \exp (-\varepsilon_a/kT), \quad (3)$$

где величина ε_a составляет $4.0 \div 0.2$ мэВ и зависит от дозы облучения и температуры подложки.

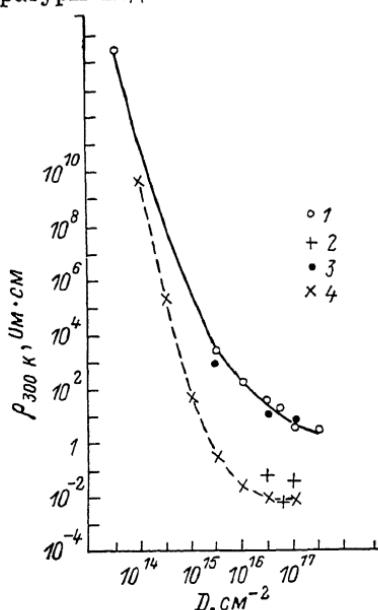


Рис. 2. Дозовая зависимость ρ_{300} К полииамида ПМ, облученного Ar^+ (1, 2) и N^+ (3).

2 — образцы, облученные без охлаждения подложки; 4 — данные [4].

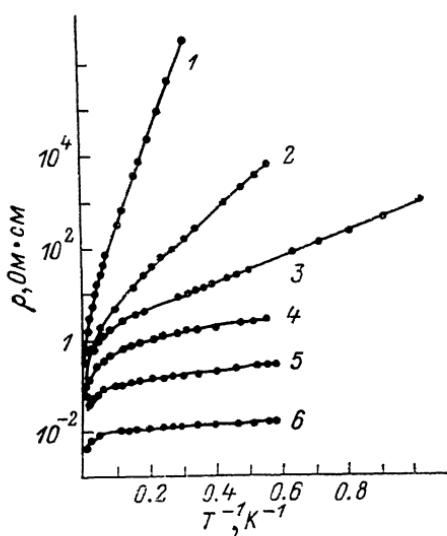


Рис. 3. Температурная зависимость удельного сопротивления пленок ПМ, полученных облучением на горячей подложке.

Цифры у кривых соответствуют номерам образцов. Дозы облучения, см^{-2} : 1, 2 — $3 \cdot 10^{16}$, 3—6 — $1 \cdot 10^{17}$. Варьировалась температура подложки.

Анализ ВАХ проводящих слоев облученного полииамида ПМ показал, что омичность сохраняется в полях до 1 В/см (рис. 4). При $E > 1$ В/см в области неомичности зависимость $\sigma(E, T)$ может быть описана выражением

$$\sigma(E, T) = \sigma_0 \exp (eEl/kT). \quad (4)$$

Величина l , имеющая размерность длины, для образца 3 при $T = 4.2 \div 1.7$ К составляла $100 \div 200$ Å и росла с понижением температуры как $l \sim T^{-k}$, причем $k \sim 0.8$ при $T > 3.0$ К и $k \sim 0.5$ при более низких температурах. В сильных электрических полях при $E > 300$ В/см наблюдалась безактивационная проводимость, не зависящая от температуры.

При температурах ниже 4.2 К и в магнитных полях до 60 кЭ в облученных слоях полииамида ПМ наблюдалось отрицательное магнитосопротивление (ОМС) (рис. 5). В полях от 4 до 30 кЭ зависимость ОМС от магнитного поля H хорошо описывается выражением $\ln [\rho(H)/\rho(0)] \sim H^{0.5}$; при $H > 30$ кЭ наблюдалось ослабление этой зависимости. С ростом дозы облучения величина ОМС при постоянной температуре уменьшалась

и в пределах погрешности измерений не наблюдалось анизотропии продольного и поперечного ОМС.

Частотные зависимости проводимости образца № 2 при различных температурах (рис. 6) описываются выражением

$$\sigma(\omega, T) \sim \omega^{p(T)}. \quad (5)$$

В области $\omega < 10^6$ Гц при понижении температуры от 4.2 до 1.2 К величина p растет от 0.14 до 1.0. Вблизи $\omega = 10^6$ Гц наблюдается излом частотных зависимостей проводимости и при $\omega > 10^6$ Гц зависимость $\sigma(\omega, T)$ становится более сильной (p изменяется от 1.0 до 1.7) и менее чувствительной к изменению температуры.

Экспериментальные данные, относящиеся к исследованию сигнала ЭПР, будут приведены в конце статьи, а сейчас обсудим представленные результаты.

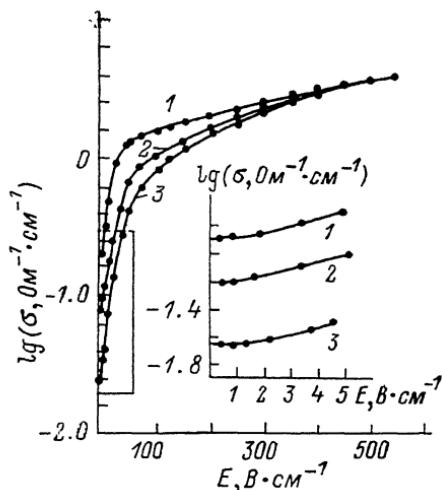


Рис. 4. Зависимость $\lg \sigma$ от E для образца № 3 при $T=4.2$ (1), 2.8 (2), 1.72 К (3).

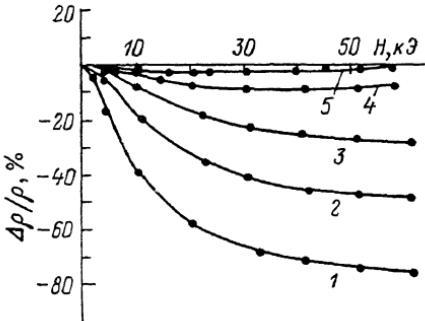


Рис. 5. Магнитосопротивление образца № 3 при $T=0.47$ (1), 0.66 (2), 0.97 (3), 1.54 (4), 2.1 К (5).

2. Обсуждение

Сильная дозовая зависимость проводимости, а также характер температурной, полевой и частотной зависимостей проводимости облученных пленок полииамида ПМ указывают на то, что на диэлектрической (полупроводниковой) стороне основным механизмом переноса заряда при $T < 300$ К являются прыжки носителей по локализованным состояниям [11, 12]. Если полагать, что локализованные состояния, по которым осуществляются прыжки электронов, хаотично распределены в трехмерном пространстве, то по аналогии с прыжковой проводимостью в легированных кристаллических полупроводниках [11] можно оценить радиус локализации электронной волновой функции a . Для этого используем выражение для концентрационной зависимости удельного прыжкового сопротивления² $\rho_3 = \sigma_3^{-1}$

$$\rho_3 = \rho_0 \exp [\alpha / N^{1/a}], \quad (6)$$

где N — концентрация локализованных состояний, $\alpha = 1.7$ — численный коэффициент.

В нашем случае величину N можно связать с дозой облучения D : $N \sim \beta D/d$, где d — глубина модифицированного слоя, β — количество центров на один падающий ион. Обработка данных рис. 2 показывает, что для области $D < 3 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$ выражение (6) хорошо выполняется (рис. 7), что позволяет по величине наклона определить значение a : при

² В качестве оценки величины ρ_3 принято значение $\sigma_{300 \text{ K}}^{-1}$.

$\beta=1$ значение $a \sim 5 \text{ \AA}$. Полученное значение a представляется вполне разумным (ошибка в определении a , связанная с произвольным выбором β , не слишком велика, так как $a \sim \beta^{-1/2}$), что подтверждает модель прыжковой проводимости.

В области низких температур модель прыжкового механизма проводимости согласуется также с характером зависимостей $\sigma(T)$, $\sigma(E, T)$,

$\sigma(\omega, T)$. Так, скользящая энергия активации проводимости в законе (2) с $m \sim 0.5$ объясняется механизмом прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка в условиях существования на уровне Ферми параболической «мягкой» квазищели [11]. Согласно этой модели, зная радиус локализации a и параметр T_0 из (2), можно независимо оценить величину l ,

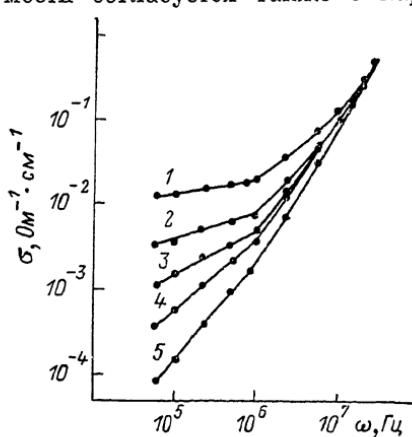


Рис. 6. Частотная зависимость проводимости образца № 2 при $T=4.2$ (1), 3.0 (2), 2.4 (3), 1.7 (4), 1.2 К (5).

определенную по формуле (4) для нелинейной области ВАХ (в нашем случае l должна быть порядка радиуса корреляции бесконечного кластера l_c , величина которого существенно превышает $r_m(T)$ — максимальную

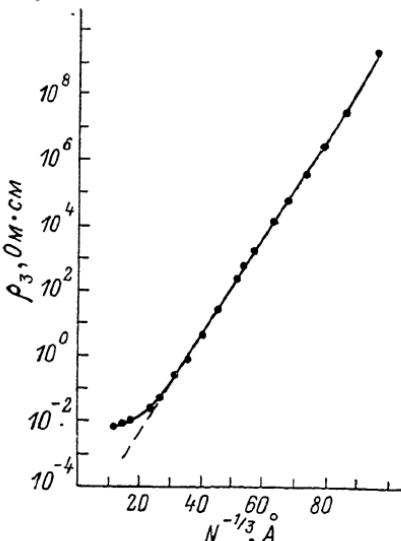


Рис. 7. Зависимость $\rho_{300 \text{ K}}$ от $N^{-1/2}$ для каптона из [4].

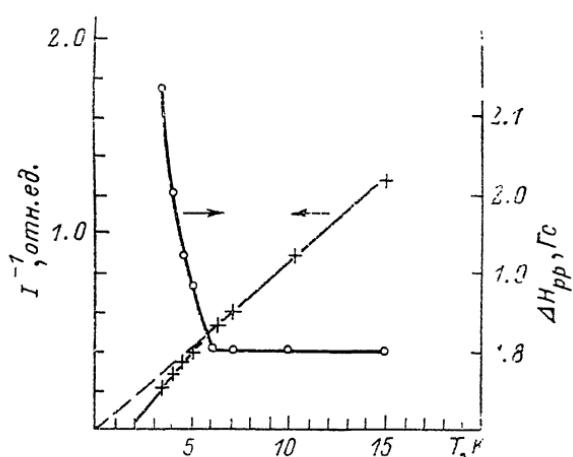


Рис. 8. Температурные зависимости приведенной интегральной интенсивности I^{-1} и ширины линии ΔH_{pp} сигнала ЭПР пленки полимида, облученной дозой $1 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2}$.

длину прыжка при данной температуре). Учитывая, что $r_m(T) \sim a (T_0/T)^{1/2}$, получаем

$$l_c = r_m(T) a (T_0/T)^{1/2} \sim a (T_0/T). \quad (7)$$

Для образца № 3 при $T=3.0 \text{ K}$ ($T_0=43 \text{ K}$, $a=5 \text{ \AA}$) оценка по формуле (7) дает значение $l_c=70 \text{ \AA}$, что удовлетворительно совпадает с экспериментом (100 \AA).

Частотные зависимости проводимости, описываемые формулой (5) с $p < 1$ (при $\omega < 10^6 \text{ Гц}$), рассматриваются также как свидетельство

прыжкового механизма проводимости [12]. При этом имеется в виду «парная модель», в основе которой лежит представление об элементарном диполе — паре центров локализации, между которыми происходит перескок электрона. Теория в этом случае дает показатель степени в формуле (5) $p=0.8$.

Рассмотрим вновь зависимость $\sigma(T)$ (рис. 3). Механизм прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка (2) должен наблюдаться в области температур, когда $kT < \Delta$ (где Δ — ширина кулоновской квазищели), и продолжаться при $T \rightarrow 0$. Однако при $T < 4.0$ К в зависимости $\sigma(T)$ наблюдался переход от скользящей к постоянной энергии активации (3). В этой же области температур наблюдался эффект ОМС, причем величина ОМС резко возрастала с понижением температуры (рис. 5). (Подобное явление только при $T < 1.0$ К наблюдалось ранее при исследовании прыжковой проводимости аморфных пленок $\text{Ge}_{1-x}\text{Cr}_x$ [13]).

Наблюдаемые эффекты по аналогии с [13] могут быть объяснены проходящей при $T < 4.0$ К в облученных слоях полиимида ПМ перестройкой электронного спектра, связанной с магнитным упорядочением типа «спиновое стекло». Спиновые корреляции, проявляющиеся при низких температурах, способствуют взаимной ориентации спинов примесных центров. Параллельная ориентация (ферромагнитное взаимодействие) приводит к появлению дополнительного обменного отталкивания электронов. Таким образом, на электрон-электронное взаимодействие, приводящее к «мягкой» кулоновской щели в плотности состояний, накладывается обменное взаимодействие. Это приводит к нулевой плотности состояний не только на уровне Ферми, но и вблизи некоторой его окрестности, что проявляется в виде «жесткой» магнитной щели ε_a в температурной зависимости проводимости. Естественно, что на величину щели сильное влияние оказывает магнитное поле. При этом оказывается, что уменьшение ε_a , к которому приводит большое ОМС, зависит от H/T . Таким образом, магнитное поле и высокая температура подавляют спиновые корреляции, приводящие к появлению «жесткой» щели. Эффектом усиления экранирования обменного взаимодействия, ответственного за магнитное упорядочение, можно объяснить уменьшение эффекта ОМС при фиксированной температуре, наблюдающееся при приближении к переходу диэлектрик—металл.

Изложенная модель, качественно объясняющая характер зависимостей $\sigma(T)$ и $\sigma(H, T)$ при $T < 4.0$ К, получила подтверждение в экспериментах по исследованию температурной зависимости сигнала ЭПР: его ширины ΔH_{pp} и интегральной интенсивности I ($I = \Delta H_{pp}^2 A$, где A — амплитуда производной сигнала поглощения ЭПР) при $T < 30$ К. В спектре ЭПР облученных пленок наблюдается узкая одиночная линия с $g=2.0003$ лоренцевой формы, ширина и интенсивность которой зависят от дозы облучения. Дозовые зависимости концентрации парамагнитных центров (ПЦ) имеют немонотонный характер. Максимальная концентрация ПЦ для пленок, полученных на холодной подложке, наблюдается при дозах $1 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$, и их концентрация составляет $\sim 3 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$; при дозах меньше $3 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$ наблюдается примерно по одному неспаренному электрону на имплантированный ион. Уменьшение концентрации спинов при больших дозах, сопровождающееся небольшим увеличением ширины линии, связано, по-видимому, с образованием немагнитных дефектов в результате взаимодействия и рекомбинации ПЦ.

Анализ температурной зависимости сигнала ЭПР показал, что при температурах ниже 10 К наблюдаются уширение линии ЭПР и отклонение температурной зависимости интегральной интенсивности сигнала ЭПР от закона Кюри (рис. 8). Это отклонение свидетельствует о ферромагнитном характере обменного взаимодействия в данном интервале температур. В рамках модели обменно-связанных спиновых пар [14] была проведена оценка величины обменного интеграла J , которая показала, что J хорошо коррелирует с величиной энергии активации проводимости в (3) в той же температурной области (так, для образца № 4, облученного с до-

зой 10^{17} см $^{-2}$, ε_a и $|J| \sim 0.2$ мэВ). Наличие обменного взаимодействия в системе парамагнитных центров, возникающих в полимере при ионной бомбардировке, и положительный знак обменного интеграла подтверждают возможность перехода системы при $T \rightarrow 0$ в магнитоупорядоченное состояние.

Изложенный материал позволяет сделать следующие выводы.

1. Для резкого возрастания проводимости облученных ионами пленок полииамида ПМ необходимо повышение температуры подложки в процессе облучения.

2. В результате облучения достигнута проводимость $\sigma_{300\text{ K}} = 200$ Ом $^{-1}\cdot\text{см}^{-1}$, имеющая металлический характер.

3. На диэлектрической стороне проводимость облученных пленок объясняется прыжковым механизмом, что подтверждается характером зависимостей $\sigma(T)$, $\sigma(E, T)$, $\sigma(\omega, T)$.

4. Появляющиеся при $T < 4.0$ К в облученных слоях полииамида ПМ корреляции в ориентации спинов парамагнитных центров, образующихся при ионной бомбардировке, приводят к эффекту магнитного упорядочения в системе локализованных спинов, что следует из анализа зависимостей $\sigma(T)$, $\sigma(H, T)$, и температурной зависимости сигнала ЭПР.

Л и т е р а т у р а

- [1] Potember R. S., Hoffman R. C., Hu H. S. et al. // Polimer. 1987. V. 28. N 4. P. 574—580.
- [2] Skotheim T. A. Handbook of conducting Polymers / Ed. M. Deccer. N. Y., Basel, 1986. V. II. P. 1417.
- [3] Brown H. B., Tomkiewicz Y., Aviram A. et al. // Sol. St. Commun. 1980. V. 35. N 2. P. 135—139.
- [4] Hioki T., Noda S., Sugiura M. et al. // J. Appl. Phys. Lett. 1983. V. 43. N 1. P. 30—32.
- [5] Venkatesan T., Forrest S. R., Kaplan M. L. et al. // J. Appl. Phys. 1983. V. 54. N 6. P. 3150—3153.
- [6] Wasserman B., Dresselhaus M. S., Braunstein G. et al. // J. El. Mater. 1985. V. 14. N 2. P. 157—169.
- [7] Yoshida K., Iwaki M. // Nucl. Instr. and Methods in Phys. Res. 1987. V. B 19/20. N 2. P. 878—881.
- [8] Jonson W. S., Gibbons J. F. Projected Range Statistics in Semiconductors. Stanford University, 1969. 217 p.
- [9] Svinivasan R., Braven B., Dreyfus R. W. // J. Appl. Phys. 1987. V. 61. N 1. P. 372—376.
- [10] Антонова Т. А., Шукарев А. В., Тот А. и др. // Высокомол. соед., сер. Б. 1987. Т. 29. № 8. С. 584—589.
- [11] Шкловский Б. И., Эфрос А. Л. Электронные свойства легированных полупроводников. М., 1979. 416 с.
- [12] Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. М., 1982. 664 с.
- [13] Алешин А. Н., Ионов А. Н., Парфеньев Р. В. и др. // ФТТ, 1988. Т. 30. № 3. С. 696—699.
- [14] Вонсовский С. В. Магнетизм. М., 1971. 1032 с.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
19 мая 1988 г.